PARTIAL TRANSLATION OF JAPANESE EXAMINED PATENT PUBLICATION (KOKOKU) NO. 05-037269 (REFERENCE 1)

Title of the Invention: MEASUREMENT METHOD OF SUBSTRATE

CONCENTRATION IN FLUID

Publication Date: January 8, 1987

Patent Application No.: 60-142003

Filing Date: June 28, 1985

Applicant: NOK CORPORATION

[Extract from description]

[on page 2, in column 4, line 34 to page 3 in column 5, line 10]

As shown in Fig.1a and 1b, two Si monocrystalline substrates surfaces (in planar direction 100) are processed by an anisotropic etching technology so that the one becomes to a channel cope 1 and the other becomes to a channel drag 2.

A curved channel of the present invention are formed by bonding these processed surfaces of the two substrates oppositely.

Then, an inlet 3 is processed on channel drag 2, an outlet 4 is processed on channel cope 1 so that the both channels connect in the center of the substrate when the channel cope and the channel drag face.

The section of the channel formed by bonding a channel cope 1 and channel drag 2 oppositely is shown in Fig. 1a. When the fluid which flow this channel goes from drag channel 3' to cope channel 4', the channel is bend so that the fluid contact with a top face of the channel cope at angles more than 50 degrees.

The window is open at the wall which the flow of this fluid bends and contacts and glucose sensor 6 placed on glass substrate 5 is fixed so that glucose sensor 6 looks into from the rear face.

[Figs.1 and 2]

- 1: a channel cope
- 2: a channel drag
- 3: an inlet
- 4: an outlet
- 5: a glass substrate
- 6: a glucose sensor
- 7: an enzyme immobilizing membrane
- 11: a carrier liquid
- 12: a sample liquid
- 13: an injection valve
- 14: a sampling tube
- 15: a detection cell

(Note: In order to save on translation costs, we have prepared a brief partial translation of this reference at this time. However, if you would like to have more details on the contents of this reference, we can prepare a full English translation thereof. Therefore, please instruct us to do so, if necessary.)

(19) 日本国特許庁(JP) (11) 特許出願公告

◎特許公報(B2)

平5-37269

Solnt. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

❷❸公告 平成5年(1993)6月2日

G 01 N 27/28

321 G

7235-2 J

発明の数 1 (全6頁)

❷発明の名称

流体中の基質濃度の連続的測定方法

②特 顧 昭60-142003 ❸公 期 昭62-2150

②出 願 昭60(1985)6月28日

@昭62(1987)1月8日

@発 明 者

森泉 豊栄

東京都世田谷区奥沢3の22の6

— 鄭 @発明 者 高津

神奈川県横浜市戸塚区汲沢1の23の5

の出 頭 人 エヌオーケー株式会社 東京都港区芝大門 1 丁目12番15号

四分代 理 人 弁理士 吉田 俊夫

審査官

矢 嶋

多参考文献

特開 昭58-180942(JP,A)

特公 昭58-26968 (JP, B2)

1

釣特許請求の範囲

1 二枚の板状体の各内面に対応する傾斜凹凸面 を形成させ、かつ同二枚の板状体を隙間をおいて 対接させて組み合わせることにより、内部に傾斜 端部にセンサーを配設して、流路に流される流体 を前記センサーに傾斜して吹き付けるごとくして 接触させ、流体中の基質濃度を測定することを特 徴とする流体中の基質濃度の連続的測定方法。

- 2 傾斜屈曲した流路がSi単結晶基板(100面) 10 を異方性エツチング加工して形成されたものであ る特許請求の範囲第1項記載の流体中の基質濃度 の連続的測定方法。
- 3 傾斜屈曲した流路に流される流体が50°以上 囲第1項又は第2項記載の流体中の基質濃度の連 続的測定方法。

発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

に関し、特に基質濃度を測定すべき流体を流路に 流し、その基質濃度をその変化に即時に追従させ ながら、連続的に検出器で測定する方法に関す

点)

2

従来より、液体中の化学的情報、即ち出、各種 基質の濃度、色や蛍光の光学的特性などの測定 は、主して断続的に行なわれてきた。

また、これらの測定用検出器についても、液体 屈曲した流路を形成し、その傾斜屈曲した流路の 5 中で用いられることを前提とした各種センサーの 開発及び小型化の研究も各方面で行なわれている が、いずれもその殆どは液体中の光学的情報を断 続的にある一点で検出しようとするものであつ

一方、コンピューターなどの情報処理システム の目覚ましい発達で、大量の情報を高速で処理す ることが可能となり、これに応じてその情報源で ある各種センサーにも、高速かつ連続的な測定性 能が求められるようになつてきているが、いうま の角度をもつてセンサーに接触する特許請求の範 15 でもなく、これに加えて、量産性やコストなどの 面から、その小型化も重要な開発テーマの一つと なつている。

最近では、近年発達の著しいLSIプロセス技術 を各種センサー製作プロセスに応用することで、 本発明は、流体中の基質濃度の連続的測定方法 20 こうした諸要求をみたすものが実用化されてお り、その主なものとしては、半導体、薄膜あるい はセラミツクスなどを利用した圧力、温度、光、 磁力などのセンサーが挙げられる。

しかしながら、前述の液体中の化学的情報を検 (従来の技術及び発明が解決しようとする問題 25 出するためのセンサーについては、それの小型化 の研究は進められているものの、小型でかつ連続

的な測定を可能にしようとするような研究は殆ど 行われていないのが実情である。そして、液体の 連続的測定方式そのものを小型化するためには、 センサーのみを小型化するだけでは無意味であ り、試料液体の連続注入システム(フローインジ 5 的に測定する方法を開発した。 エクションシステム)とセンサーとを一体化した 上で小型化する必要がある。

従来から、液体を連続的かつ効率よく測定する ためには、試料液体をセンサーの検出面に対して 約45°の角度の方向より注入してやる必要のある 10 斜屈曲した流路の端部にセンサーを配設して、流 ことが分かつている。これは、一様な流れの中 に、流路を塞ぐことなくセンサーを配置しようと すると、液体のもつ粘性のために、センサーの表 面に極めて薄い液体の不動層が形成され、このた めに試料濃度が刻々と変動するような場合には、15 センサー表面での試料液体の更新が生じ難く、セ ンサーとしての応答性が悪くなる問題があるため で、その対策として上記のごとく45°の角度で処 理することによつて不動層の発生を解消し、常に 新しい液体試料がセンサー面と接触するようにな 20 ことができる。

第3図には、そのようなセンサーの一例が示さ れており、H₂O₂電極、PI電極などのセンサー2 1上に設置された選択性透過膜、酵素固定膜など の機能膜22の検出面に対し、試料液体はこれに 25 対して45℃の角度に穿設された注入口23から注 入され、同様の角度の排出口24から排出される ような3次元的な構造を有する注入セルが示され ている。

度加工が要求されるばかりでなく、センサー自体 の小型化が必ずしもシステム全体の小型化につな がらないので、連続測定システムの小型化、低コ スト化はこうした観点からは達成することができ ない。

本発明者らは、先に、こうした45°という液体 試料の注入角度設定を不要とする方法の一法とし て、センサー近傍に超音波振動を与えて試料液体 の不動層発生を阻止することによって、液体試料 中の基質濃度を的確に連続測定することを可能と 40 る。 する方法を提供した(特願昭60-41976号)。

(問題点を解決するための手段)

本発明者は、更に不動層発生を解消する測定方 法について研究を進めた結果、液体試料の流路 4

を、内面に傾斜凹凸面を有する二枚の板状体を対 接させて組み合わせることにより、内部に屈曲し た流路として形成し、その屈曲部にセンサーを配 設して、流路に流される流体中の基質濃度を連続

本発明はすなわち、二枚の板状体の各内面に対 応する傾斜凹凸面を形成させ、かつ同二枚の板状 体を隙間をおいて対接させて組み合わせることに より、内部に傾斜屈曲した流路を形成し、その傾 路に流される流体を前記センサーに傾斜して吹き 付けるごとくして接触させ、流体中の基質濃度を 測定することを特徴とする流体中の基質濃度の連 続的測定方法、である。

こうした傾斜屈曲した流路の製作は、二枚の板 状体の各内面を傾斜した凹又は凸面を形成するよ うに蝕刻あるいは切削し、それらを一枚の凸面に 他の一枚の凹面が一定の流路間隔を置いて対接さ せて組み合わせることによつて、容易に実施する

センサーによる測定は、流路に流される流体が 約50°以上の角度をもつてセンサーに接触するよ うにして行えば、常に新鮮な流体の基質濃度を測 定することができるのである。

そして検出器は二枚の板状体分程度の厚さで構 成できるため、非常に薄型なものとなる。

更に流路の製作については、昨今のLSIプロセ スを利用するSi単結晶の異方性エッチング加工を 応用すれば、非常に効果的に実施することがで このような構造の注入セルは、その製作に高精 30 き、その結果検出器と一体化された注入セルを非 常に小型なものとすることができる。

(2) 本発明の具体的な方法の一例について述べ

第1図a, bに示すごとく、2枚のSi単結晶基 **35 板面(面方向は100)を異方性エッチング技術に** より、1枚は流路上型1、他の1枚は流路下型2 となるように加工する。

流路の形成はこれら2枚の基板の加工面を対向 接着することにより本発明の屈曲流路を形成す

このとき流路は注入口側3は流路下型2に、排 出口側4は流路上型1にそれぞれ加工されてお り、かつ、上、下型が対向した時、両型中の流路 が基板ほぼ中央で連絡するような配置になってい

上下型を対向接着して形成した流路の断面は図 1aのようになつており、この流路を流れる流体 が下型流路3'から上型流路4'に向かう時に流路 が屈曲され、上型の流路上面に50°以上の角度で 5 接触することになる。この流体の流れが屈曲して 接触する壁部には窓が開いており、裏面より、例 えばガラス基板5上に配設されたグルコースセン サー6が覗くように固定されている。

る。その原理は、単結晶のエッチング加工におい て、エツチング速度が結晶面の面方向依存性を有 することを利用して特定形状のエッチング断面を 得ることにある。例えばSi単結晶面(100面)を チング側面は加工面に対し常に55°の傾斜を形成 することとなる。

その工程は

る。

- (i) Si単結晶表面に酸化皮膜形成
- ターニング (フオトエツチング)
- ③ 10~44%KOH80°でエッチング(異方性エッ チング)

④ 洗浄

からなり、工程①、②はLSIプロセスで用いられ る手法と同様の工程であるため、高精度、微小加 工ができるのである。

6

またグルコースセンサーについては、これはガ ラス基板5上にH₂O₂電極(白金電極)6、即ち アノードとして白金薄膜、カソードとして銀薄膜 が適宜なパターンに形成されたものであり、これ ら電極部の少なくとも試料流との接触部にはグル ここで異方性エツチングについての概略を述べ 10 コースオキシターゼを固定化した酵素固定化膜 7 が形成されている。

なお、測定用流体としては、主に血液や尿等を 対象としているが、その中の基質濃度の測定にお いては各種被測定基質の種類に応じて適当な酵素 適当なエツチャントでエツチングすればそのエツ 15 と電極を組み合わせて構成した酵素センサーが用 いられる。その主な組み合わせを表1に示すが、 更にこれら異なる種類の酵素センサー複数個を同 一基板上に形成することにより、同時に複数種の 基質濃度を検出、測定することができる。また、 ② 酸化皮膜をフォトリソグフライ工程によりパ 20 各電極の代わりに半導体を用いたイオン感応型 FET(ISFET) を用いれば更に小型なものが得ら れる。

表

1

		A	-	
方法	被測定物質	固定化酵素	組合わせ電極	感応物質
アンベロメ トリー	グルコース	グルコースオキシダーゼ	隔膜酸素電極	O ₂
	過酸化水素	カタラーゼ	(クラーク型酸素電極)	//
	尿酸	ウリカーゼ	"	"
		_{ インベルターゼ		
	しよ糖	くムタロターゼ	"	"
		しグルコースオキシダーゼ		
	遊離 コレス テロール	コレステロールオキシダーゼ	IJ	"
	グルコース	グルコースオキシダーゼ	白金電極	H_2O_2
	L-アミノ酸	L-アミノ酸オキシダーゼ	"	"
	エタノール	アルコールデヒドロゲナーゼ	白金電極	補酵素
	グルコース	グルコースオキシダーゼ	"	酸化還元色素
ポテンショ メトリー	尿素	ウレアーゼ	アンモニウムイオン電極	NH4 +
	レアミノ酸	L-アミノ酸オキシダーゼ	"	"
	尿素	ウレアーゼ	炭酸イオン電極	HCO³ _
	レアミノ酸	{L-アミノオキシダーゼ ベルオキシダーゼ	よう素イオン電極	I-

8

方法	被測定物質	固定化酵素	組合わせ電極	感応物質
i	アミグダリン	βーグルコシダーゼ	シアンイオン電極	CN-
	ペニシリン 中性脂質	ベニシリナーゼ リパーゼ	水素イオン電極 #	H+ "

10

- (2) 上記構成の検出セルは第2図 a のごとき測定 システム中で用いられるがこのシステムは下記 のように作動する。
 - ① まず、測定前においてはキヤリア液11が ポンプP1によりインジェクションバルプ1 3を経て検出セル15中を流れている。一 方、試料液12はポンプP2によりインジェ クションパルプ13に接続されたサンプリン 15 グチユーブ14中を満たしており、測定時イ ンジエクションパルプ13を操作することに より、瞬時にその流路が第2図bのように切 替わり、サンプリングチューブ14中の試料 液12がキャリア液11に運ばれ、検出セル 20 15へ達する。
 - ② 検出セル**15**では、第1図図示のごとく注 入口3より注入された試料流は下型流路3′ を経て上型流路4′へと流れる。
 - ら上型流路4′へと屈曲され、流体は上型流 路4'の上壁、即ちグルコースセンサー6の 検出面に打ち当たることになる。

ところで、Si単結晶の (100) 面を異方性 エツチング加工することによつて流路を形成 30 すると、その流路側面の傾きは基板面に対し 約55°となるが、下型流路から上型流路へ向 かう試料流体もほぼ同程度の角度で検出面に 打ち当たることになる。従つて検出面での液 体の不動層の発生を抑制することができ、35 45°方向からの試料注入法とほぼ同程度の効 果を得ることができる。

④ この時、検出面では例えば検出器がグルコ ースセンサーの場合には、試料流体中にグル コースが基質として存在すると、下記の反応 40 が起こり、酸素が消費されてグルコン酸 (ラ クトン)とH2O2とが生成される。

グルコース+O₂→グルコノラクトン+ H₂O₂これは、電極面上の膜7に固定された

グルコースオキシターゼの酸化触媒としての 働きによるものである。

⑤ 両電極間には0.6Vの直流電圧が印加され ており、このH₂O₂の発生により、その発生 量に応じて、それぞれ次のような反応が生

[アノード側] H₂O₂→2H⁺+O₂+2e⁻ [カソード側] 2e⁻ + 2H⁺ + 1 / 2O₂ → H₂O

外部回路へ微小電流変化として検出され る。このようにして、試料流体中のグルコー ス濃度を電気的に連続的に取り出すことがで きるのである。

更に、第1図bに他の実施例を示すが、この場 合は、下型流路3′を流れてきた試料流が屈曲さ れて基板面に対し50以上。の方向で上部検出器6 の検出面に接触した後更に屈曲されて排出口4へ ③ この際において、試料流は下型流路3'か 25 流れて行く。したがつて、この例では検出器6の 検出面付近の流れに大いに屈曲され、よつて検出 面付近の流れが大いに乱され、新鮮な試料流が接 触流通することとなる。

(発明の効果)

本発明は、以上の構成により次のような作用効 果を奏する。

- ① 本発明に係る検出器セルは、二枚の板状体の 各内面に対応する傾斜凹凸面を形成させ、かつ 同二枚の板状体を隙間をおいて対接させて組み 合わせることにより構成できるため、流路パタ ーンを小型化しかつ非常に簡単に製作できる。 そしてセンサーに対する測定対象物流体の接触 は傾斜して吹き付けるごとく行われるため、常 に流体は更新されてセンサーに接触し、よつて 連続的に流体の測定を正確に実施することがで きる。
- ② 流路材質にSi単結晶を用いたばあいには、更 にSiの半導体としての性質を利用すれば流路基 板上に各種センサーや周辺の集積回路を形成す

ることも可能である。

③ 流路の加工にLSIプロセスと同様の工程を用いることができるため、小型で高精度な加工ができ更に多数個同時加工が可能である。

図面の簡単な説明

第1図aは本発明の実施例で用いられる検出セルの斜視図、bは他の実施例の斜視図、第2図aは測定システム概略図、bは測定時インジエクシ

10

ョンパルブの流路、第3図は従来の測定方法を示す。

符号の説明、1……流路上型、2……流路下型、3……注入口、3'……下型流路、4……排5 出口、4'……上型流路、5……ガラス基板、6 ……グルコースセンサー (H₂O₂電極)、7……酵素固定膜。

第1図









